OptoTech

OWI 150 XT 1500

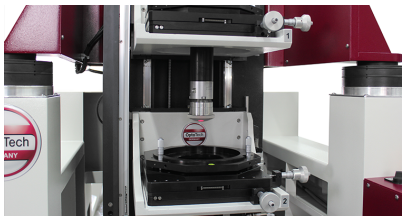
Prüfturm zur interferometrischen Formmessung sphärischer und asphärischer Optikbauteile

Hochpräzises Fizeau-Werkstattinterferometer für das Prüfen von sphärischen und asphärischen Bauteilen. Eine hochgenaue Kinematik und ein Messstrahldurchmesser bis zu Ø 150 mm machen dieses Messgerät zu einem unentbehrlichen Werkzeug für die Fertigung von Hochleistungsoptiken.

OptoTech

Technische Daten

	OWI 150 XT 1500
Anwendung	Interferometrischen Formmessung von sphärischen und asphärischen optischen Komponenten
Messbereich Durchmesser (abhängig vom verwendeten Objektiv und Interferometermodul)	1 mm - 150 mm
Messbereich Radius	Abhängig vom verwendeten Objektiv
Anschluss	4" oder 6" Bayonett-Anschluss (abhängig vom Interferometermodul)
Messgenauigkeit	λ/20 (abhängig vom verwendeten Objektiv)
Verfahrweg	1500 mm
Strombedarf (andere auf Anfrage)	1.0 KW
Abmessungen	Breite: 1150 mm, Höhe: 2600 mm, Tiefe: 1500 mm; Ohne Tisch
Gewicht (ca.)	1600 kg
Disclaimer	Änderungen der Daten ohne Ankündigung vorbehalten. Wenden Sie sich zur Klärung von Einzelheiten bitte an OptoTech.



OptoTech

Highlights

- Aufbau optimiert für den Einsatz im Produktionsumfeld
- Messstativ aus schwingungsabsorbierendem Granit für höchste Messgenauigkeit und Steifheit
- Lagerung über passive Luftdämpfungselemente auf stabilem Stahl-Grundgestell
- Radienschlitten mit spielfrei vorgespannten Wälzlagerführungen, Antrieb über Servomotor
- Wahl der Geschwindigkeit stufenlos über Joystick, Verfahrweg 1500 mm
- 3-Achsentisch (Z-Achse in Basisgerät; verschiedene X-Y-Varianten optional)
- Heidenhain Glasmaßstab mit 5 µm Grund-Messgenauigkeit über den gesamten Verfahrweg zur genauen Absolutmessung von Radien. Maßstab nahe der optischen Achse (Abbe'sches Komperationsprinzip)
- Radienachse laserinterferometrisch vermessen (inkl. Messprotokoll)
- Verschiedene Optionen leistungsstarker Interferometermodule (LT Ultra Module 4" / 6" oder Zygo QualiFire 4" / 6") und entsprechender Softwarelösungen zur Auswertung Ihrer Messergebnisse
- Inklusive mobilem PC-Arbeitsplatz mit integriertem Schaltschrank und Aufbewahrungssystem

Systemvorteile

- Raumsparender Aufbau und gute Zugänglichkeit durch Umlenkung der Strahlachse über Spiegelsystem
- Messstativ aus schwingungsabsorbierendem Granit für höchste Messgenauigkeit und Steifheit

Optionen

- Erweiterbar auf Zweitischvariante (Asphärenmessoption und Systemmessoption)
- Laser-Messsystem Optional für 1-Tisch-Version
- Dämpfungssysteme Optional Passiv oder Aktiv
- Planmessungen möglich über zusätzlichen Kipptisch
- Verschiedene Auflageringe
- Laserinterferometrische Fehlerkompensation auf Messgenauigkeit ±1µm
- Automatisches Radienmessung-Modul
- Optional Planflächen, Asphären und Systeme im doppelten Durchgang

Stand: 17.03.2025, Änderungen vorbehalten

OptoTech Optikmaschinen GmbH
Sandusweg 2-4 | 35435 Wettenberg / Germany | T +49 641/49939-0 | info.de@optotech.net | **optotech.net**